#### TP4

Similitud de compuestos y clusterización

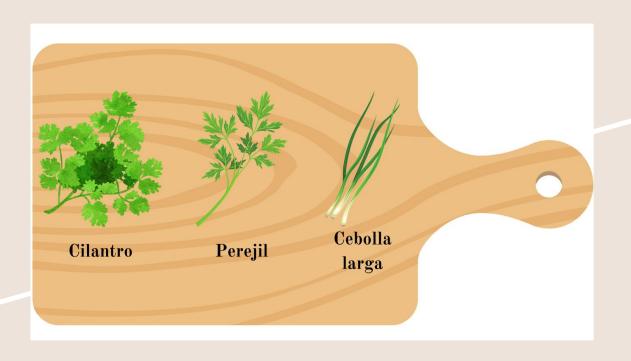
#### Objetivos

- 1) Aprender a calcular similitud molecular usando fingerprints y métricas de RDKit.
- 2) Aplicar clusterización jerárquica y K-means para agrupar compuestos.
- 3) Visualizar y analizar relaciones entre moléculas mediante PCA y heatmaps.

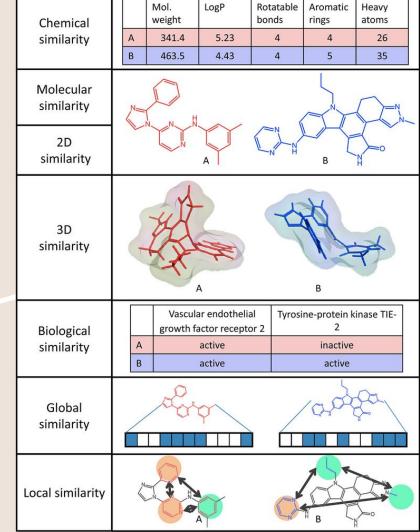
#### Organización de la clase

9:00 a 9:30	Introducción al TP
9:30 a 10:30	Trabajo en la guía de ejercicios (Parte 1: Clusterización por Fingerprints)
10:30 a 11:00	Recreo
11:00 a 12:00	Trabajo en la guía de ejercicios (Parte 2: Clusterización por PCA)
12:00 a 13:00	Lectura de paper y puesta en común

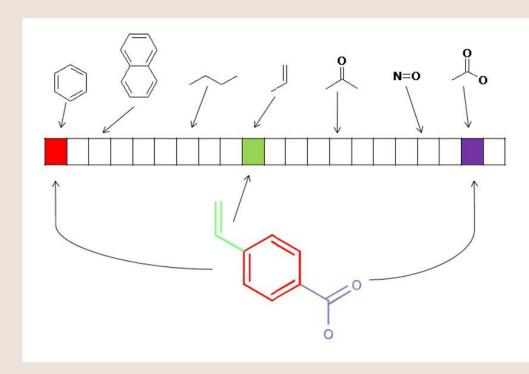
#### Similitud

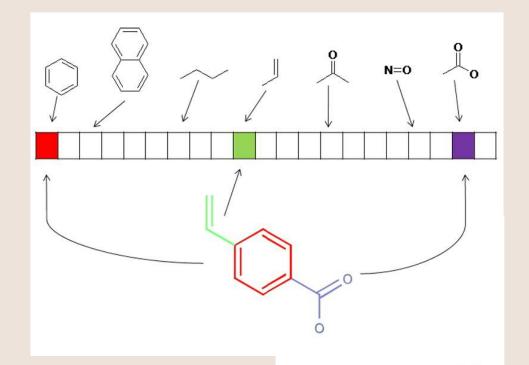


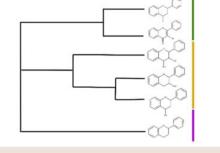
#### Similitud



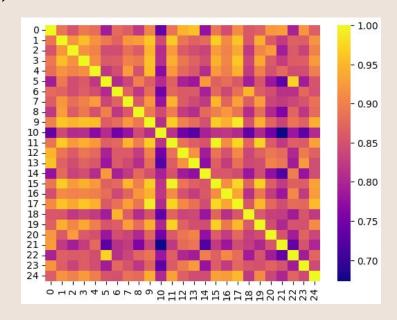
#### Parte 1

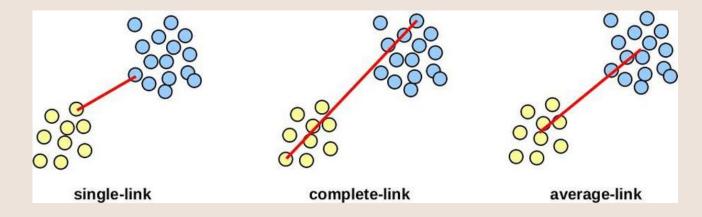




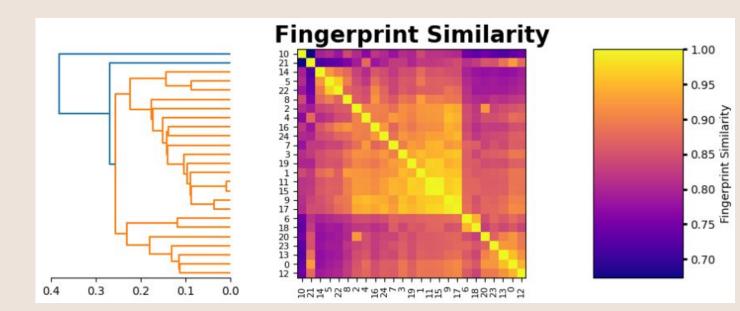


- ) Calcular Mol de cada molécula con RDKit
- 2) Calcular el FingerprintMol de cada molécula
- 3) Armar la matriz de similitud

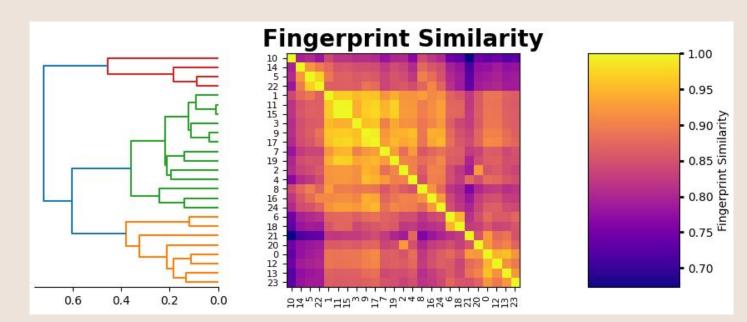




Clusterizar con single



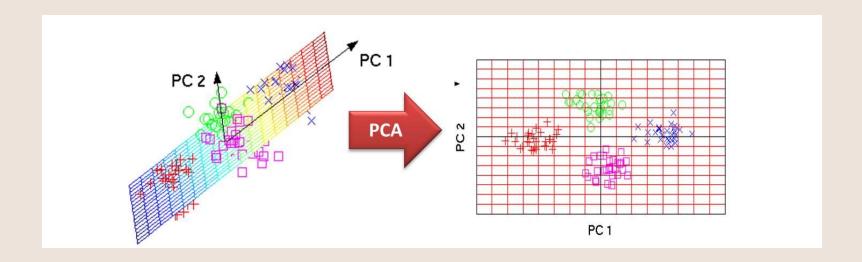
Clusterizar con complete



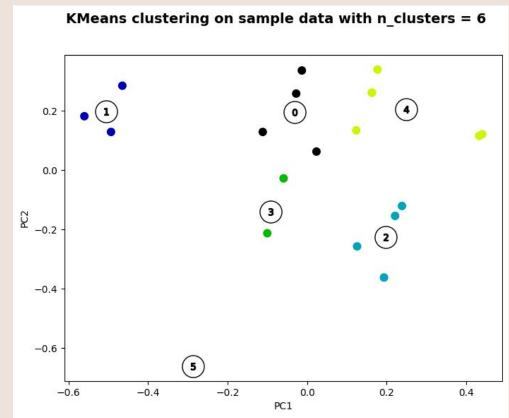
#### Parte 2

#### Clusterización por PCA

# Clusterización por PCA



# Clusterización por PCA KMear



#### En resumen!

	Criterios para clusterizar
Fingerprints	Similitud estructural
PCA	Similitud de propiedades fisicoquímicas

#### Objetivos

- 1) Aprender a calcular similitud molecular usando fingerprints y métricas de RDKit.
- 2) Aplicar clusterización jerárquica y K-means para agrupar compuestos.
- 3) Visualizar y analizar relaciones entre moléculas mediante PCA y heatmaps.

#### Cierre





pubs.acs.org/jcim

Article

#### Improving Measures of Chemical Structural Similarity Using Machine Learning on Chemical—Genetic Interactions

Hamid Safizadeh, Scott W. Simpkins, Justin Nelson, Sheena C. Li, Jeff S. Piotrowski, Mami Yoshimura, Yoko Yashiroda, Hiroyuki Hirano, Hiroyuki Osada, Minoru Yoshida, Charles Boone, and Chad L. Myers\*



Cite This: J. Chem. Inf. Model. 2021, 61, 4156-4172



https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jcim.0c00993?ref=pdf https://github.com/csbio/VS-SVM